

2026年度ナノプロセス施設(NPF)単価表

2026年4月1日改訂

装置番号	装置名称	設置場所	装置分類	トレーニング カテゴリ	備考(注1)	利用報告書提出& データ提供			利用報告書提出			利用報告書非提出(注4) & データ提供			利用報告書非提出(注4)		
						機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8,000	20,000	22,000	11,200	28,000	30,800	16,000	44,000	44,000	22,400	56,000	61,600
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF008	スピコンター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1	有償トレーニング	500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF011	露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィ	3	技術代行専用	19,500	31,500	33,500	27,300	44,100	46,900	52,000	76,000	80,000	72,800	106,400	112,000
NPF012	有機ドラフトチャンバー 右(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF013	有機ドラフトチャンバー 左(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF014	有機ドラフトチャンバー 右(EB)(注6)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 右	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	6,200	30,200	34,200	7,700	30,200	34,200
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	10,400	30,400	36,400	14,500	42,500	50,900
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10,400	20,400	23,400	14,500	28,500	32,700	29,000	49,000	55,000	40,600	68,600	77,000
NPF021	ブラスマッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	9,000	19,000	22,000	12,600	26,600	30,800	19,000	39,000	45,000	26,600	54,600	63,000
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5,000	15,000	18,000	7,000	21,000	25,200	10,000	30,000	36,000	14,000	42,000	50,400
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	6,000	16,000	19,000	8,400	22,400	26,600	12,000	32,000	38,000	16,800	44,800	53,200
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2,600	14,600	16,600	3,600	20,400	23,200	8,000	32,000	36,000	11,200	44,800	50,400
NPF030	ブラスマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4,600	14,600	17,600	6,400	20,400	24,600	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8,000	18,000	21,000	11,200	25,200	29,400	19,200	39,200	45,200	26,800	54,800	63,200
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF033	アルゴミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13,000	25,000	27,000	18,200	35,000	37,800	29,000	53,000	57,000	40,600	74,200	79,800
NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9,100	19,100	22,100	12,700	24,600	28,100	25,000	45,000	51,000	35,000	59,500	65,100
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付帯)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2,000	11,000	13,000	2,800	15,400	18,200	6,400	24,400	28,400	8,900	34,100	39,700
NPF044	マップ炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV/Dimension3100](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700](注8)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4,000	16,000	18,000	5,600	22,400	25,200	10,400	34,400	38,400	14,500	48,100	53,700
NPF048	ナノスケール顕微鏡SPM_3[SFT-3500](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5,200	17,200	19,200	7,200	24,000	26,800	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF049	ナノプローブ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10,400	22,400	24,400	14,500	31,300	34,100	22,400	46,400	50,400	31,300	64,900	70,500
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9,500	11,500	700	13,300	16,100	4,000	22,000	26,000	5,600	30,800	36,400
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	5,600	25,600	31,600	7,800	35,800	44,200
NPF053	ワイヤーボンダー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4,600	16,600	18,600	6,400	23,200	26,000	13,000	37,000	41,000	18,200	51,800	57,400
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	その他	0		500	9,500	11,500	500	9,500	11,500	4,000	22,000	26,000	5,000	22,000	26,000
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	1,300	11,300	14,300	1,800	15,800	20,000	4,000	24,000	30,000	5,600	33,600	42,000
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	7,200	25,200	29,200	10,000	35,200	40,800
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	9,000	27,000	31,000	12,600	37,800	43,400
NPF063	分光エリブノメータ(注7)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2,600	11,600	13,600	3,600	16,200	19,000	8,000	26,000	30,000	11,200	36,400	42,000
NPF064	解析用PC(分光エリブノメータ用)(注7)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF065	顕微鏡レーザーラマン分光装置(RAMAN)(注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF066	顕微鏡レーザー変換赤外分光装置(FT-IR)(注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF067	解析用PC(SPM, FT-IR, Raman用)(注8)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	700	17,500	20,300	4,000	28,000	32,000	5,600	39,200	44,800
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	3,300	13,300	16,300	4,600	18,600	22,800	7,200	27,200	33,200	10,000	38,000	46,400
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4,000	14,000	17,000	5,600	19,600	23,800	10,400	30,400	36,400	14,500	42,500	50,900
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2,600	12,600	15,600	3,600	17,600	21,800	6,400	26,400	32,400	8,900	36,900	45,300
NPF073	解析用PC(X線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF074	X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	9,600	29,600	35,600	13,400	41,400	49,800
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12,500	14,500	500	12,500	14,500	4,000	28,000	32,000	5,000	28,000	32,000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5,200	15,200	18,200	7,200	21,200	25,400	16,000	36,000	42,000	22,400	50,400	58,800
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)																